

Introduction

This special issue is an outgrowth of the 2001 Canadian Workshop on MEMS (August 17, Ottawa) organized by the Canadian Microelectronics Corporation. The large number of participants prompted the members of the CWMEMS 2001 Technical Committee to invite participants to submit papers for review. This special issue of the *Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering* is the result.

MEMS (microelectromechanical systems) research in Canada is now fairly widespread, and numerous groups are looking into applied research on MEMS and microsystems. It is also apparent that various groups have taken up systematic analysis and simulation of MEMS devices and microsystems. Varied research topics from miniature gas sensors to state-of-the-art RF switches are presented in the papers that appear in this issue.

As always in such endeavours, there are many people to thank: the CWMEMS 2001 Technical Committee, the Canadian Microelectronics Corporation, and Dr. Om Malik at the *CJECE*. But above all we would like to thank the many reviewers who reviewed the paper submissions and provided insightful and valuable comments.

Dr. Ted Hubbard
Mechanical Engineering Department
Dalhousie University

Dr. Ash Parameswaran
Department of Engineering Science
Simon Fraser University

Guest Editors

Ce numéro est le produit du Colloque canadien sur les MEMS (17 août, Ottawa) organisé par la Société canadienne de microélectronique. Le nombre important de participants a incité les membres du comité technique de CWMEMS 2001 à inviter les participants à soumettre des articles pour publication dans la *Revue*. Ce numéro spécial de la *Revue canadienne de génie électrique et informatique* est le résultat de cette initiative.

La recherche canadienne sur les MEMS (systèmes microélectromécaniques) est maintenant répandue et plusieurs groupes mènent des travaux sur les MEMS et les microsystemes. Il est aussi possible de constater que plusieurs groupes ont entrepris des analyses systématiques de même que des simulations de dispositifs MEMS et de microsystemes. Plusieurs avenues de recherche, allant des capteurs de gaz miniatures aux interrupteurs RF haute performance, sont présentées dans les articles de ce numéro.

Une telle entreprise exige comme toujours la participation de nombreuses personnes qu'il convient de remercier chaleureusement: les membres du Comité technique de CWMEMS 2001, la Société canadienne de microélectronique et l'éditeur de la *Revue*, le Dr Om Malik. Nous souhaiterions souligner plus particulièrement la contribution des arbitres qui ont évalué les manuscrits et fourni des commentaires pertinents aux auteurs.

Dr Ted Hubbard
Département de génie mécanique
Université Dalhousie

Dr Ash Parameswaran
Département d'ingénierie
Université Simon Fraser

Éditeurs invités